

2025年6月より

新素材共同研究開発センター  
2025年度共同利用研究に供する装置一覧

装置責任者：新素材共同研究開発センター長 加藤秀実  
電話番号 215-2114 eメールアドレス :hidemi.kato.b7

1. 作製支援グループ

装置名	副装置責任者	副装置責任者連絡先		装置担当者	装置担当者連絡先	
		電話番号	eメールアドレス		電話番号	eメールアドレス
1-1 極微細加工用電子描画・エッチング装置	関 剛斎 教授	215-2095	takeshi.seki	山崎 匠 助教	215-2097	takumi.yamazaki.d5
1-2 多元系反応スバツ装置				佐々木 知子 技術職員	215-2375	tomoko.sugiyama.a6
1-3 高速反射電子回折装置				伊藤 啓太 助教	215-2097	keita.ito.e3
1-4 複合イオンビーム成膜装置				佐々木 知子 技術職員	215-2375	tomoko.sugiyama.a6
1-5 多段制御化学気相析出装置	梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu	佐々木 知子 技術職員	215-2375	tomoko.sugiyama.a6
1-6 熱間加工再現試験機	加藤 秀実 教授	215-2114	hidemi.kato.b7	山中 謙太 准教授	215-2115	kenta.yamanaka.c5
1-7 放電プラズマ焼結装置 SPS-1050				原田 晃一 技術職員	215-2375	koichi.harata.e7
1-8 放電プラズマ焼結装置 SPS-3.20 Mark IV				原田 晃一 技術職員	215-2375	koichi.harata.e7
1-9 電子ビーム溶解装置				菅原 孝昌 技術職員	215-2799	takamasa.sugawara.d3
1-10 高圧ガス噴霧装置				Yim Seungkyun 助教	215-2158	yim.seungkyun.a3
1-11 高周波溶解式傾角鋳造装置				梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
1-12 単ロール液体急冷装置				梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
1-13 光学式浮遊帯域熔融炉				菅原 孝昌 技術職員	215-2799	takamasa.sugawara.d3
1-14 電子ビーム式浮遊帯域熔融装置				菅原 孝昌 技術職員	215-2799	takamasa.sugawara.d3
1-15 高周波加熱単結晶作製装置				菅原 孝昌 技術職員	215-2799	takamasa.sugawara.d3
1-16 真空高温炉				野村 明子 技術職員	215-2799	akiko.nomura.d7
1-17 高周波溶解炉				菅原 孝昌 技術職員	215-2799	takamasa.sugawara.d3
1-18 超高温浮遊溶解型複合セラミックス作製装置				菅原 孝昌 技術職員	215-2799	takamasa.sugawara.d3
1-19 小型真空アーク溶解装置				野村 明子 技術職員	215-2799	akiko.nomura.d7
1-20 大型真空アーク溶解装置	野村 明子 技術職員	215-2799	akiko.nomura.d7			
1-21 横型帯域熔融アーク炉	野村 明子 技術職員	215-2799	akiko.nomura.d7			
1-22 高温反応焼結炉	野村 明子 技術職員	215-2799	akiko.nomura.d7			

eメールアドレス以下:@tohoku.ac.jp

電話市外局番:022

## 2. 評価支援グループ

装置名	副装置責任者	副装置責任者連絡先		装置担当者	装置担当者連絡先		
		電話番号	e-メールアドレス		電話番号	e-メールアドレス	
2-1	磁気特性評価システム	関 剛斎 教授	215-2095	takeshi.seki	伊藤 啓太 助教	215-2097	keita.ito.e3
2-2	微小部X線回折装置	加藤 秀実 教授	215-2114	hidemi.kato.b7	村上 義弘 技術職員	215-2375	yoshihiro.murakami.e6
2-3	試料水平式エックス線回折装置				村上 義弘 技術職員	215-2375	yoshihiro.murakami.e6
2-4	X線光電子分光分析装置 (XPS)				大村 和世 技術職員	215-2375	kazuyo.omura.b1
2-5	電界放出形走査電子顕微鏡 (FE-SEM)				成田 一生 技術職員	215-2375	issei.narita.b4
2-6	フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザー (FE-EPMA)				成田 一生 技術職員	215-2375	issei.narita.b4
2-7	走査電子顕微鏡 (W-SEM)				成田 一生 技術職員	215-2375	issei.narita.b4
2-8	超伝導量子干渉計 (SQUID)	梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu	梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
2-9	示差走査熱量測定装置 (DSC)				黄胤禎 助教	215-2233	huang.yin.chen.a3
2-10	汎用型熱分析測定システム (DTA,DSC,TMA)				黄胤禎 助教	215-2233	huang.yin.chen.a3
2-11	高輝度X線粉末構造解析装置				谷口 貴紀 助教	215-2039	takanori.taniguchi.d3
2-12	温度可変磁化測定装置 (VSM)				黄胤禎 助教	215-2233	huang.yin.chen.a3
2-13	背面反射デジタルCCDラウエカメラ				黄胤禎 助教	215-2233	huang.yin.chen.a3
2-14	熱電特性評価装置				梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
2-15	レーザーフラッシュ法熱定数測定装置				梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
2-16	静的粒子画像分析装置	加藤 秀実 教授	215-2114	hidemi.kato.b7	遠藤 嵩英 技術職員	215-2375	takahide.endo.e5
2-17	平面・断面イオンミリング装置				成田 一生 技術職員	215-2375	issei.narita.b4
2-18	微小ビッカース硬度計				原田 晃一 技術職員	215-2375	koichi.harata.e7

e-メールアドレス以下: @tohoku.ac.jp

電話市外局番: 022